

108學年度第2學期

教室名稱及代號:化材館二樓材料系教室ME205 教室容量:35

列印日期:2020-03-09 列印

節次/ 時間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
08:10 09:00 第一節							
09:10 10:00 第二節		6834 材料分析與檢測 蔡銘洪	6828 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	6830 熱電材料 張立信	4162 半導體製程 與設備概論 武東星		
10:10 11:00 第三節		6834 材料分析與檢測 蔡銘洪	6828 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	6830 熱電材料 張立信	4162 半導體製程 與設備概論 武東星		
11:10 12:00 第四節		6834 材料分析與檢測 蔡銘洪	6828 磁記錄原理與應用 蔡佳霖	6830 熱電材料 張立信	4162 半導體製程 與設備概論 武東星		
13:10 14:00 第五節							
14:10 15:00 第六節		6826 陶瓷製程 曾文甲		4118 固態物理導論 劉恒睿			
15:10 16:00 第七節		6826 陶瓷製程 曾文甲	4167 半導體元件物理 賴盈至	4118 固態物理導論 劉恒睿			
16:10 17:00 第八節		6826 陶瓷製程 曾文甲	4167 半導體元件物理 賴盈至	4118 固態物理導論 劉恒睿			
17:10 18:00 第九節			4167 半導體元件物理 賴盈至				
18:20 19:10 第A節							
19:15 20:05 第B節							
20:10 21:00 第C節							
21:05 21:55 第D節							